

氧化膜测厚仪

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 氧化膜测厚仪 |
| 公司名称 | 中科朴道技术（北京）有限公司 |
| 价格 | 4000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市海淀区上地西里颂芳园4号楼509室 |
| 联系电话 | 010-65070866-808 13910845852 |

产品详情

氧化膜测厚仪仪器特点 采用了磁性和涡流两种测厚方法，即可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度又可测量非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度；

具有两种测量方式：连续测量方式（CONTINUE）和单次测量方式（SINGLE）；

具有两种工作方式：直接方式(DIRECT)和成组方式(Appl)；设有五个统计量：平均值（MEAN）、最大值（MAX）、最小值（MIN）、测试次数（NO.）、标准偏差（S.DEV）；

可采用两种方法对仪器进行校准,并可用基本校准法对测头的系统误差进行修正；

具有存贮功能：可存贮500个测量值；具有删除功能：对测量中出现的单个可疑数据进行删除，也可删除存贮区内的所有数据，以便进行新的测量；可设置限界：对限界外的测量值能自动报警；

能实时显示电量；操作过程有蜂鸣声提示，并可选择关闭蜂鸣器；

待机时间可调，超过待机时间自动关闭；屏幕亮度可调；屏幕的分辨率可调；

具有错误提示功能，通过屏显或蜂鸣器声进行错误提示；设有两种关机模式：手动关机和自动关机。

氧化膜测厚仪主要技术参数：测头类型 FN 工作原理 磁感应 涡流 测量范围(μm)

0~1250 0~1250其中：铜上镀铬(0~40) 低限分辨力(μm) 0.1 0.1 示值误差

一点校准(um) $\pm(3\%H+1) \pm(3\%H+1.5)$ 二点校准(μm) $\pm[(1\sim3)\%H+1] \pm[(1\sim3)\%H+1.5]$

测试条件 最小曲率半径(mm) 凸 1.5 凸3 最小面积的直径(mm) 7 5

基体临界厚度(mm) 0.5 0.3

氧化膜测厚仪主要功能参数 采用了磁性和涡流两种测厚方法，即可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度又可测量非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度；具有探头零点校准、两点校准功能，

可对系统误差进行自动修正；可预先设置厚度值上、下限，超出范围自动报警；

具有耦合状态提示功能；有LED背光显示，方便在光线昏暗环境中使用；